2. Методы измерения твердости материалов (обзор) / Е. И. Орешко [и др.] // Труды ВИАМ. – 2020. – № 1. – С. 101–117.

3. Структура и оптические свойства покрытий алмазоподобного углерода / Н. М. Чекан [и др.] // Изв. НАН Беларуси. Сер. Физ.-тех. наук. – 2018. – Т. 63. – № 3. – С. 280–289.

4. Княжев, Ф. Р. Обзор возможностей применение алмазоподобных пленок в различных отраслях / Ф. Р. Княжев, М. М. Сергеевна // Материалы конференций ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» апрель 2021. – 2021. – С. 28.

## УДК 621.315.592 ИССЛЕДОВАНИЕ СФЕРАОБРАЗНЫХ НАНОСТРУКТУР, СФОРМИРОВАННЫХ В ОБЪЕМЕ ПЛАСТИН МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ Францкевич А.В., Францкевич Н.В., Мартинович В.А.

Белорусский национальный технический университет Минск, Республика Беларусь

Аннотация. Основная идея представляемой работы – исследовать условия получения и свойства сфера образных наноструктур, формируемых в объеме пластин монокристаллического кремния. Стандартные пластины Cz-Si, п типа имплантировались ионами водорода при разных температурах и разными дозами. Формирование объемных наноструктур, происходило в результате обработки образцов в DC плазме водорода, при температуре не выше 300 °C. Полученные структуры исследовались методами СЭМ и комбинационного рассеяния. СЭМ-исследование проводилось как в режиме вторичных электронов (SE), так и в режиме поверхностно-индуцированного потенциала (SEBIV). Исследования показали, что в приповерхностном слое кремниевых пластин формируются сфера образные (пузырьковые) наноструктуры. Данные комбинационного рассеяния позволяют предположить о накоплении, в полученных структурах, газообразного водорода.

Ключевые слова: кремний, сфера образные наноструктуры, водород.

## STUDY OF THE SPHERE OF SHAPED NANOSTRUCTURES FORMED IN THE VOLUME OF MONOCRYSTAL SILICON PLATES Frantskevich A., Frantskevich N., Martinovich V.

## Belarusian National Technical University Minsk, Belarus

**Annotation.** The main idea of this work is to investigate the conditions for the preparation and properties of sphere-shaped nanostructures formed in the bulk of single-crystal silicon wafers. Standard Cz-Si, n type plates were implanted with hydrogen ions at different temperatures and different doses. The formation of bulk nanostructures occurred as a result of processing the samples in DC hydrogen plasma at a temperature not higher than 300 °C. The resulting structures were investigated by SEM and Raman scattering methods. The SEM study was carried out both in the secondary electron (SE) mode and in the surface-induced potential (SEBIV) mode. Studies have shown that sphere-shaped (bubble) nanostructures are formed in the near-surface layer of silicon wafers. Raman scattering data suggest the accumulation of hydrogen gas in the resulting structures. **Key words:** silicon, spherical nanostructures, hydrogen.

#### e-mail: N\_Frantskevich@bntu.by

Введение. Эффект образования протяженных дефектов в конструкционных материалах, при содержании в них водорода или гелия с концентрацией 5–10 атомных процента известен достаточно давно [1]. В микроэлектронной технологии практическое применение данного эффектаотщепление тонких слоев кристаллических материалов по технологии Smart-Cut [2]. Авторами статьи, была показана принципиальная возможность создания структур типа кремний\оксид кремния на месте протяженных дефектов [3]. Данные структуры можно формировать на определенной глубине, в виде систем вертикальных нанотрубок, или конических структур на поверхности. Одно из возможных практических применений указанных выше структур – это увеличение эффективности солнечных элементов. Но на пути успешной коммерческой реализации данной технологии есть следующее препятствие – сравнительно высокие дозы имплантированного водорода или гелия, что в значительной степени влияет на себестоимость конечного изделия. В связи, с этим актуальным вопросом в разрабатываемой технологии было снижении дозы имплантированных ионов. Решение данного вопроса возможно за счет частичной замены сравнительно дорогостоящей технологической операции – имплантации, на более дешевую – плазменную обработку, при двух стадийном процессе. На первом этапе имплантацией водорода или гелия, при дозах имплантации 1·10<sup>14</sup>–5·10<sup>15</sup> ат.\см<sup>2</sup> формируется слой первичных дефектов. На слой первичных дефектов, производится геттерирование водорода, вводимого в кремний из DC плазмы. В дальнейшем, введенный дополнительно водород, формирует протяженные дефекты с необходим распределением по объему или поверхности. Экспериментальное исследование возможных условий обработки, при которых реализуется предложенный подход, а так же получаемые наноструктуры, изучались в данной работе.

Эксперимент. В первой серии образцов использовались стандартные пластины *п*-типа 4,5 Ω·ст Cz Si. Данные образцы имплантировались протонами при комнатной температуре с энергией 100 keV флюенсом 1·10<sup>16</sup>, 2·10<sup>16</sup> или 4 10<sup>16</sup> ат.\см<sup>2</sup>. Во второй серии образцов, пластины кремния анологичные используемым в первой серии, имплантировались протонами при температурах 150, 300, 400 или 500 °С. Флюенс ионов составлял 1·10<sup>14</sup>, 1·10<sup>15</sup> или 5·10<sup>15</sup> ат.\см<sup>2</sup> для каждой из температур. После создания первичного дефектного слоя, водород вводился в кремний из DC плазмы при 150 °C. Спектры комбинационного рассеяния снимались при комнатной температуре с использованием газового Ar<sup>+</sup> лазера с длинной волны 488 нм и выходной мощностью 20 мВт. Образ поверхности образцов, а так же глубинных наноструктур, был получен в СЭМ, в режиме вторичных электронов (SE) и в режиме поверхностно индуцированного потенциала (SEBIV), сответсвенно.

**Результат.** На рис. 1, a и  $\delta$  представлен типичый образ поверхности и структура сфера образных нано-структур, полученные в СЭМ, в режиме SE (a) и SEBIV ( $\delta$ ), от образцов кремния из первой серии.



Рисунок 1 – Типичный образ поверхности, для первой серии образцов, полученный в СЭМ, в режиме SE (*a*) и SEBIV (*б*)

При проведении эксперимента, для установления однозначной зависимости, что сфера образные наноструктуры, формируются именно в области с предварительно созданным дефектным слоем, использовались образцы содеращие две области, не имплантированную, и имплантированную. Как видно из результатов представленных на рис. 1,  $\delta$ , наблюдаются две области, содержащие сфера образные структуры, и без них. Доказательством того, что данные структуры образуются именно в имплантированных областях, является то что, в исходных, не имплантированных образцах, подобных структур не наблюдалось. Кроме этого, размер образований зависит от флюенса предимплантированных протонов. С увеличение флюенса, диаметр сфер увеличивается.

Для перевой и второй серии образцов, а так же исходных, не имплантированных но обработанных в плазме водорода образцов. проводилось снятие спектров комбинационного рассеяния. Проведенные исследования показали, что для исследуемых образцов форма и положение основной линии кремния (521 см<sup>-1</sup>) практически не зависят от температуры образцов во время имплантации. Для образцов имплантированных дозами 1 10<sup>14</sup>, 1 10<sup>15</sup> или 5 10<sup>15</sup> при температуре 300 °С и обработанных в плазме водорода при 150 °C, спектры комбинационного рассеяния, нормализованные по основной линии кремния, для спектрального диапазона в областях LVM сопостовляемых SiH связям (a) и водородной молекуле H<sub>2</sub> (3800-4400 cm<sup>-1</sup>), представлены на рис. 2  $(a, \delta)$ .



Рисунок 2 – Спектры комбинационного рассеяния в областях LVM сопоставляемых SiH связям (*a*) и водородной молекуле H<sub>2</sub> (*б*), для Cz Si п-типа пластин, имплантированных протонами при 300 °C, дозами 1·10<sup>14</sup> см<sup>-2</sup> (*1*), 1·10<sup>15</sup> см<sup>-2</sup> (*2*) и 5·10<sup>15</sup> (*3*) см<sup>-2</sup> и обработанных в плазме водорода при 150 °C

Как видно из представленных результатов, на спектрах комбинационного рассеяния, наблюдается зависимость формы и местоположения LVM сопостовляемых SiH связям и H<sub>2</sub> молекулы, в зависимости от флюенса предимплантированных протонов. А именно, с увеличением дозы предимплантированных протонов интенсивность сигнала LVM от H<sub>2</sub> молекулы уменьшается. Поскольку именно при флюенсе  $(0,5-1)\cdot10^{16}$  см<sup>-2</sup> предимплантированных протонов, на результатах SEBIV начинает наблюдаться образование сфера образного объемного нанослоя, это позволяет предположить о возможности накопления газообразного водорода в этом слое.

**Благодарности.** Работа выполнена в рамках программы «Наноматериалы и нанотехнологии» (ГПНИ 2.24).

#### Литература

1. Terreault, B. Physica status solidi / B. Terreaul. – 2007. – Vol. 204. – P. 2129.

2. Bruel, M. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B, 1996. - Vol. 313.

## УДК 620.178.1

## ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВАКУУМНО-ДУГОВОГО НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО ФОСФОРОМ

Хабарова А.В.<sup>1</sup>, Лапицкая В.А.<sup>1, 2</sup>, Кузнецова Т.А.<sup>1, 2</sup>, Куприн А.С.<sup>3</sup>, Чижик С.А.<sup>1, 2</sup>, Трухан Р.Э.<sup>1</sup>, Конеру А.<sup>4</sup>

Коперу А

<sup>1</sup>ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси» <sup>2</sup>Белорусский национальный технический университет Минск, Республика Беларусь <sup>3</sup>ННЦ Харьковский физико-технический институт НАН Украины Харьков, Украина <sup>4</sup>Somnio Global Новай, США

Аннотация. Приведены результаты исследований свойств вакуумно-дугового никелевого покрытия, легированного фосфором (NiP), толщиной 2 мкм после триботехнических испытаний методом атомносиловой микроскопии. Испытания проводились при нагрузке от 3,45 до 6,89 мкН за 40 циклов. В результате определены основные характеристики триботехнических свойств – коэффициент  $k_{\rm rp}$  и сила трения  $F_{\rm rp}$ , глубина износа *h* и удельный объемный износ  $\omega$ . Установлено, что с увеличением нагрузки коэффициент и сила трения снижаются.

Ключевые слова: вакуумно-дуговое покрытие, NiP, атомно-силовая микроскопия, триботехнические испытания, коэффициент трения.

# TRIBOTECHNICAL PROPERTIES OF VACUUM-ARC NICKEL COATING DOPED WITH PHOSPHORUS

Khabarava A.<sup>1</sup>, Lapitskaya V.<sup>1,2</sup>, Kuznetsova T.<sup>1,2</sup>, Kuprin A.<sup>3</sup>, Chizik S.<sup>1,2</sup>, Trukhan R.<sup>1</sup>, Koneru A.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of NAS of Belarus <sup>2</sup>Belarusian national technical university Minsk, Republic of Belarus <sup>3</sup>NSC Kharkov Institute of Physics and Technology of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkov, Ukraine <sup>4</sup>Somnio Global Novi, USA

**Abstract.** The results of studies of the properties of a vacuum-arc nickel coating doped with phosphorus (NiP), 2  $\mu$ m thick after tribotechnical tests by atomic force microscopy are presented. The tests were carried out at a load of 3.45 to 6.89 mkN for 40 cycles. As a result, the main characteristics of the tribotechnical properties were determined – the coefficient  $k_{fr}$  and the friction force  $F_{fr}$ , the wear depth h, the specific volumetric wear  $\omega$ . It was found that with an increase in the load, the coefficient and the friction force decrease.

Key words: vacuum arc coating, NiP, atomic force microscopy, tribotechnical tests, coefficient of friction.

Адрес для переписки: Хабарова А.В., ул. П. Бровки, 15, г. Минск 220072, Республика Беларусь e-mail: AV.Khabarova@mail.ru

Введение. Вакуумно-дуговые никелевые покрытия характеризуются хорошей износо- и корозионностойкостью, высокой твердостью. Легирование фосфором приводит к повышению физикомеханических и триботехнических свойств таких покрытий. Наличие на поверхности вакуумнодуговых никелевых покрытий окисных пленок и различных фаз может создавать хорошие условия для формирования трибопленок [1]. Микротвердость таких покрытий может варьироваться от 2 до 17 ГПа [2]. Однако их применение ограничено недостаточным изучением свойств [1].

3. Frantskevich N. V., Frantskevich A. V., Fedo-

tov A. K., Mazanik A. V. // Journal: Solid State Phenome-

na. - 2009. - Vol. 156-158. - P. 91-94.

Целью работы является определение триботехнических свойств вакуумно-дугового никелевого покрытия, легированного фосфором, методом атомно-силовой микроскопии.

Материалы и методы исследования. Покрытия толщиной 2 мкм с концентрацией фосфора 2 ат. % нанесены на диск из нержавеющей стали 08X18H10T вакуумно-дуговым методом на